

# 光を用いた薄膜の物性評価

## ～分光エリプソメーターとテラヘルツ分光システム～

薄膜は、眼鏡やカメラレンズの反射防止膜からセンサ・デバイス素子まで多岐にわたる分野で用途が広がっており、薄膜の各種特性の評価は、材料開発、用途展開、品質管理を行っていく上で、今後ますます重要性が増すと考えられます。今回、薄膜の評価法として、光を用いた非破壊物性評価法の基礎と応用に関するセミナーを企画しました。

分光エリプソメトリーは、光と試料の相互作用による偏光の変化を測定する手法です。一方、テラヘルツ分光法は、パルス状の光を用い、電場強度の時間変化を直接観測する手法です。これらの手法は、用いる光の波長領域は異なりますが、いずれも非破壊で薄膜材料の各種物性（前者は屈折率や消衰係数、膜厚など、後者は電気伝導度、キャリア密度など）を精度良く測定することができます。

本セミナーでは、それぞれの手法の基礎と具体的な応用例についてご講演いただきます。また、当所に導入されている装置の見学も行います。多数のご参加をお待ちしております。

◆日 時：平成 30 年 11 月 7 日（水） 13：20～17：00（受付 13：00 より）

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 研修室(4)（和泉市あゆみ野2-7-1）

○当日は、セミナー開始時刻までに、本館 2 階会場前にて受付をお済ませください。

◆定 員：各 30 名（※ 受講票は発行いたしません。返信で受付をお知らせします。）

◆費 用：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 業務推進部

※ お申込みは、メール([gyoumu\\_seminar@tri-osaka.jp](mailto:gyoumu_seminar@tri-osaka.jp))

またはFAX (0725-51-2520) で

お願いします。

◆セミナー内容：

13：20～13：25 開会の挨拶

13：25～14：55

「分光エリプソメーターの基礎とその用途」

大阪府立大学大学院工学研究科 沈 用球准教授

14：55～15：05 休憩

15：05～16：00

「テラヘルツ分光による薄膜評価」

日邦プレジジョン株式会社 岩本 敏志氏

16：00～16：10 休憩

16：10～17：00 装置見学・デモ



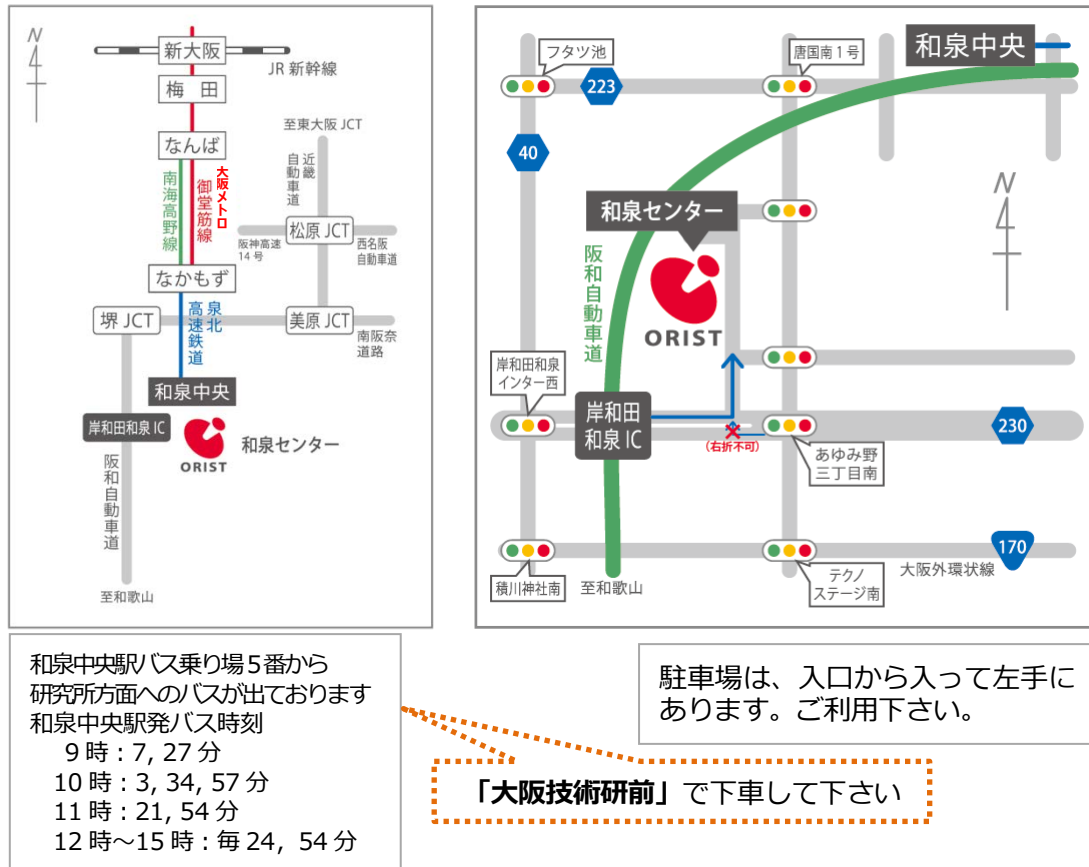
ジェー・イー・ウーラム・ジャパン  
株式会社製 分光エリプソメーター  
(公益財団法人 JKA 平成 29 年度  
機械設備拡充補助事業 導入機器)



日邦プレジジョン株式会社製  
テラヘルツ分光システム  
(平成 26 年度地域オープンイノベーション  
促進事業 導入機器)

・お問い合わせ先：業務推進部 (TEL:0725-51-2512)

## 大阪産業技術研究所 和泉センター 交通案内図（略図）



## 参加申込書

gyoumu\_seminar@tri-osaka.jp または FAX (0725-51-2520)  
(地独) 大阪産業技術研究所 和泉センター 業務推進部 行

開催日：H30.11.7（水）

会社名			
所在地	(〒 - )		
参加者	所属：	役職：	氏名： (K )
	所属：	役職：	氏名： (K )
	所属：	役職：	氏名： (K )
<b>利用者カードをお持ちの方は、「K 番号」のご記入もお願いします。</b>			
連絡先	TEL：	FAX：	
講習会の情報源	①Web ページ ②メール配信 ③チラシ ④他機関の情報 ⑤その他 ( )		

※上記参加申込書に記載された内容につきましては、本セミナーの参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。

①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。

②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内。

※ 講習会の申込状況の確認はこちら →<http://orist.jp/izumi/events/seminar/>

※ 講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版」の配信を新規にご希望の方はこちら →[http://orist.jp/mail\\_magazine/magazine\\_izumi.html](http://orist.jp/mail_magazine/magazine_izumi.html)